

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 17 年 7 月 14 日 (2005.7.14)

【公開番号】特開 2004-103578 (P2004-103578A)

【公開日】平成 16 年 4 月 2 日 (2004.4.2)

【年通号数】公開・登録公報 2004-013

【出願番号】特願 2003-299045 (P2003-299045)

【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 H 1/24

B 0 1 J 19/08

B 0 8 B 7/00

H 0 1 L 21/3065

【F I】

H 0 5 H 1/24

B 0 1 J 19/08 E

B 0 8 B 7/00

H 0 1 L 21/302 1 0 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 1 月 17 日 (2005.1.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

互いに対向する第 1 の電極及び第 2 の電極と、前記第 1 の電極の対向面に設けられたセラミックス層とを有する放電電極を用いて、前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に発生するプラズマによって被処理体にプラズマ処理を行うプラズマ処理方法において、

前記放電電極を室温よりも 10℃以上高い温度であって前記セラミックス層が吸収した水分を気化させるのに十分な温度に保持した後、プラズマ処理を開始することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項 2】

互いに対向する第 1 の電極及び第 2 の電極と、前記第 1 の電極の対向面に設けられたセラミックス層とを有する放電電極を用いて、前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に発生するプラズマによって被処理体にプラズマ処理を行うプラズマ処理方法において、

前記第 1 の電極と第 2 の電極との間で放電させ、前記放電電極を前記セラミックス層が吸収した水分を気化させるのに十分な温度に加熱した後、プラズマ処理を開始することを特徴とするプラズマ処理方法。

【請求項 3】

互いに対向する第 1 の電極及び第 2 の電極と、前記第 1 の電極の対向面に設けられたセラミックス層とを有する放電電極を用いて、前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に発生するプラズマによって被処理体にプラズマ処理を行うプラズマ処理方法において、

前記第 1 の電極と第 2 の電極との間に乾燥ガスを流した後、プラズマ処理を開始することを特徴とするプラズマ処理方法。